

2. 大型設備基盤センター以外の設備

(平成29年 7月)

受託試験料金(税込)には、同料金の30%に相当する「管理費」が加算されます。

ご相談・ご依頼の場合には、次のアドレス(kiki@adm.nitech.ac.jp)へご連絡ください。

委託事業と自主事業については、ホームページ(http://nano.web.nitech.ac.jp/)をご覧ください。

当センターの設備については、「受託試験料金表 1. 大型設備基盤センターの設備」をご覧ください。

装置名	メーカー・型番	性能・機能	受託試験料金	
			(基本料金、税込)	(追加料金、税込)
X線回折装置	リガク RINT-1100	20 mA×40 kV	5,400円	5,400円/時間
表面分析・制御装置	日本電子 JAMP-7800	カタログ仕様:元素分析(点分析、線分析、面分析)、深さ方向分析、オプション装備:試料加熱・冷却、試料破断、極薄膜堆積	32,400円	10,800円/時間
二段式軽ガス銃		衝突速度:0.8~4 km/sec 加速管内径:14 mm 通常運転間隔:3発/日	27,000円/一発	27,000円/一発
レーザーフラッシュ法 熱定数測定装置	真空理工 TC-7000	ルビレーザー出力:≥6 J/Pulse 測定温度範囲:室温~1200°C 測定物性:比熱、熱拡散率、熱伝導率	5,400円	2,160円/時間
レーザーラマン分光計	日本分光 NRS-2000	レーザー:2波長(514.5 nm, 488 nm) 分解能:0.4 cm ⁻¹ (差分トリプル) 測定可能範囲:10~8,000 cm ⁻¹ マッピング測定:可能 低波数領域測定(マクロユニット使用)	5,400円	5,400円/時間
高温型万能材料試験機	インストロン 5582	最高荷重:100 kN 最高使用温度:1200°C 試験速度:0.001~500 mm/min 駆動分解能:0.06 μm	4,320円	3,240円/時間
パルス通電焼結装置	SPSシンテックス SPS-511S	最高使用温度:2000°C 加圧範囲:5~50 kN, 到達真空度:6 Pa 試料直径:10~20 mm 焼結時の変位量測定:可能	5,400円	1,080円/時間
熱電特性測定装置	オザワ科学 RZ2001if	最高使用温度:900°C、自動測定 真空、不活性ガス中での測定:可能	10,800円	2,160円/時間
強力X線回折装置	マックサイエンス、MXP18A	回転対陰極型、Cuターゲット、18kW(電圧:20~60kV, 電流:10~400mA)	5,400円	5,400円/時間
走査電子顕微鏡	日立 S-4700	冷陰極電界放射型電子銃、分解能 1.5nm、 加速電圧 0.5~30kV、	2,160円/時間	
低温フーリエ変換(FTIR)分光器	デジラボ(現アジレント) FTS-7000	測定波数領域 4000-800 cm ⁻¹ 最高波数分解能 0.1 cm ⁻¹ 測定温度 78-300 K	2,160円/日 (+消耗品実費)	
全反射減衰フーリエ変換赤外(ATR-FTIR)分光器	デジラボ(現アジレント) FTS-6000	測定波数領域 4000-800 cm ⁻¹ 最高波数分解能 0.1 cm ⁻¹ 測定温度 277-300 K	2,160円/日 (+消耗品実費)	
X線CT装置	島津製作所社製 SMX-100CT	最大管電圧:100KV、X線検出器:イメージン テンシファイア、搭載可能試料サイズ:最大φ 180×H250(最大4Kg)、CTデータ収集時間: 10sec~30min	18,360円	5,940円/時間
	島津製作所社製 SMX-225CT	最大管電圧:225KV、X線検出器:イメージン テンシファイア、搭載可能試料サイズ:最大φ 300×H300(最大9Kg)、CTデータ収集時間: 10sec~30min		
プラズマ・ガス凝縮クラスター堆積装置	ナノ 日本ビーテック 特別仕様	クラスターサイズ 直径3~15nm 直流マグネトロンスパッタリング方式	委託事業:10,800円 自主事業:108,000円	委託事業:1,080円/時間 自主事業:10,800円/時間
高分解能透過電子顕微鏡	ナノ 日立製作所(株)社製 HF-2000	冷陰極電界放射型、加速電圧:200 kV 分解能:0.1 nm、EDX分析 スロースキャンCCDカメラ	委託事業:10,800円 自主事業:108,000円	委託事業:5,400円/時間 自主事業:54,000円/時間
メスバウアー分光装置	ナノ ラボラトリ・イクイップメント LN-6400(複合システム)、他	測定可能原子核: ⁵⁷ Fe核、 ¹¹⁹ Sn核 透過法、内部転換電子検出法	委託事業:10,800円 自主事業:108,000円	委託事業:540円/時間 自主事業:5,400円/時間
PLスペクトル・PL寿命測定装置	ナノ 自作	励起レーザー(連続波:405、532、596、 633nm、ナノ秒パルス:532nm) 470mmシングルモノクロメータ 電子冷却CCD検出器+光電子増倍管 プリアンプ、デジタルオシロスコープ クライオスタット(4.2K~300K)	委託事業:10,800円 自主事業:108,000円	委託事業:3,240円/時間 自主事業:32,400円/時間 低温測定:28,000円/試料 (温度変化測定は時間で加算)
UV/VIS/NIR分光光度計	ナノ 日本分光製 V570	付属絶対反射率測定装置ARN475	委託事業:10,800円 自主事業:108,000円	委託事業:1,080円/時間 自主事業:10,800円/時間 低温測定:28,000円/試料 (温度変化測定は時間で加算)

装置名		メーカー・型番	性能・機能	受託試験料金	
				(基本料金、税込)	(追加料金、税込)
3次非線形感受率測定装置	ナノ	自作	Zスキャン方式	委託事業:32,400円/試料/波長 自主事業:140,400円/試料/波長	委託事業:3,240円/時間 自主事業:32,400円/時間
高周波透磁率測定装置	ナノ	凌和電子(株)社製 PMF-3000	1MHz~3GHzの広帯域透磁率測定 試料サイズ5~6(W)×5(L)×1mm(t)	委託事業:5,400円 自主事業:54,000円	委託事業:2,160円/時間 自主事業:21,600円/時間
振動試料型磁束計	ナノ	東英工業(株)社製 VSM-5	最大印加磁場 1.6 T	委託事業:5,400円 自主事業:54,000円	委託事業:2,160円/時間 自主事業:21,600円/時間
高感度SQUID磁化測定装置	ナノ	日本カンタムデザイン(株)社製 MPMS5	最大印加磁場 5 T	委託・自主事業:54,000円	委託・自主事業:21,600円/時間
スパッタリング蒸着装置	ナノ	アルバック社製 SPC-2000HC	13.56MHz 200W	委託事業:10,800円 自主事業:108,000円	委託事業:1,080円/時間 自主事業:10,800円/時間
中規模カーボンナノファイバー室温合成装置	ナノ	自作	カーボンナノファイバー室温合成速度:10nm/min以上 試料サイズ:1インチ程度以下	委託事業:10,800円 自主事業:108,000円	委託事業:1,080円/時間 自主事業:10,800円/時間
単結晶X線構造解析装置	ナノ	(株)リガク社製 Mercury	Cu線源とMo線源に対応、出力 18kW、	委託事業:5,400円 自主事業:21,600円	委託事業:1,080円/時間 自主事業:4,320円/時間
質量分析装置(ESI-MS)	ナノ	Micromass社製 ECT	イオン化法:ESI, APCI、質量範囲:10~40000 Da、分解能:5000 (FWHM)	委託事業:5,400円 自主事業:21,600円	委託事業:1,080円/時間 自主事業:4,320円/時間
電子スピン共鳴装置	ナノ	日本電子(株)製 JES-RE1X	周波数:8800~9600MHz(Xバンド)、出力:0.1μW~200mW可変	委託事業:5,400円 自主事業:21,600円	委託事業:1,080円/時間 自主事業:4,320円/時間
原子間力顕微鏡	ナノ	島津製作所社製 FTM-9600	ナミックモード、位相モード、電流モード、水平力モード、磁気力モード、表面電位モード、分解能:水平0.2nm 垂直0.01nm	委託事業:5,400円 自主事業:21,600円	委託事業:1,080円/時間 自主事業:4,320円/時間
QCM電気化学システム	ナノ	(株)北斗電工製 HQ-101C	電圧・電流・時間の測定に加えて、ごく微小な質量変化を同時に測定可能、発振周波数:10MHz	委託事業:5,400円 自主事業:21,600円	委託事業:1,080円/時間 自主事業:4,320円/時間
高精度ガス/蒸気吸着量測定装置	ナノ	日本ベル株式会社製 BELSORP-max	細孔分布:直径0.35~500nm、最小比表面積:0.01m ² /g(N ₂)	委託事業:5,400円 自主事業:21,600円	委託事業:1,080円/時間 自主事業:4,320円/時間
真空蒸着装置	ナノ	シンク社製 SK-80K	マイカ基板サイズ:15×15mm(標準)、マイカ厚み:0.1~0.15mm、金膜厚:100~150nm	委託事業:5,400円 自主事業:21,600円	委託事業:1,080円/時間 自主事業:4,320円/時間
特型表面ナノ構造形成装置	ナノ	ULVAC社製 特型	標準2インチ基板、超斜め入射イオンビームによるマスクレスの表面ナノ構造・ナドット形成可能、組成制御可能、高分子材料の加工可能	委託事業:10,800円 自主事業:108,000円	委託事業:1,080円/時間 自主事業:10,800円/時間
グラフェン・カーボンナノチューブ合成装置	ナノ	自作特型	CVDによるグラフェン、単層CNTの合成	委託事業:10,800円 自主事業:108,000円	委託事業:1,080円/時間 自主事業:10,800円/時間
太陽電池評価システム	ナノ	分光計器社製	擬似太陽照射装置(キセノン150W) I-Vテスタ(太陽電池出力測定、ダイオード出力測定、環境設定) ハイパーモノライトシステム(量子効率、分光感度測定)	委託事業:10,800円 自主事業:108,000円	委託事業:1,080円/時間 自主事業:10,800円/時間
特型透過電子顕微鏡装置	ナノ	日本電子社製 JEM-2010 +特型試料ステージ	ピエゾ駆動探針を用いたナノ領域の電気特性、機械特性評価とその結晶構造との関係評価、その場抵抗加熱	委託事業:10,800円 自主事業:108,000円	委託事業:1,080円/時間 自主事業:10,800円/時間
	ナノ	日本電子社製 JEM-2100F +特型試料ステージ	FE型電子銃、他は上記と同じ	委託事業:21,600円 自主事業:129,600円	委託事業:2,160円/時間 自主事業:12,960円/時間
特型走査電子顕微鏡装置	ナノ	日本電子社製 JSM-5600 +特型試料ステージ	ピエゾ駆動探針装備、電気・機械特性測定、その場抵抗加熱	委託事業:10,800円 自主事業:108,000円	委託事業:1,080円/時間 自主事業:10,800円/時間
超精密電子材料基板平坦化装置	ナノ	MAT社製	基板直径2インチ以下。場合により8インチまで要相談。小径加工(10mm)であれば0.1度刻みで面方位制御可能。	委託事業:10,800円 自主事業:108,000円	委託事業:1,080円/時間 自主事業:10,800円/時間
低速イオン散乱分光材料表面解析装置	ナノ	島津社製	基板直径2インチ以下。元素質量はC以上計測可能。解析深さは再表面から10nm。加工基板表層解析(歪層解析が可能)	委託事業:10,800円 自主事業:108,000円	委託事業:1,080円/時間 自主事業:10,800円/時間
精密形状測定・局所磁気測定・局所電気特性評価装置	ナノ	日本電子社製 JSPM-5200TM	特型、分解能:原子分解能、CNF探針装備測定モード:形状、電気特性、磁気特性測定 冷陰極電界放出形電子銃、加速電圧:80~200kV	委託事業:10,800円 自主事業:108,000円	委託事業:1,080円/時間 自主事業:10,800円/時間
原子分解能分析電子顕微鏡	ナノ	日本電子社製 JEM-ARM200F	搭載分析装置:エネルギー分散形X線分析装置(EDS)、電子線エネルギー損失分光器	委託事業:32,400円 自主事業:162,000円	委託事業:10,800円/時間 自主事業:54,000円/時間